

## 无掩膜数字光刻机 MCML-120A



### 产品特点

采用数字微镜 (DMD) 的无掩膜扫描式光刻机, 365nm 波长、全自动化的对焦和套刻, 易于使用、晶圆连续运动配合 DMD 动态曝光, 无拼接问题。全幅面对定位精度 0.1 $\mu$ m、套刻精度: 0.2 $\mu$ m、时间 5~30 分钟、500 $\mu$ mMin. 线宽、可灰度曝光 (128 阶)、尺寸小巧, 可配合专用循环装置产生内部洁净空间

### 产品型号

MCML-120A

## 应用领域

微流控

生物芯片

MEMS

功率器件

LED等试制加工

带有2.5D图案的微光学元件

衍射光器件制作

教学

科研

## 核心参数

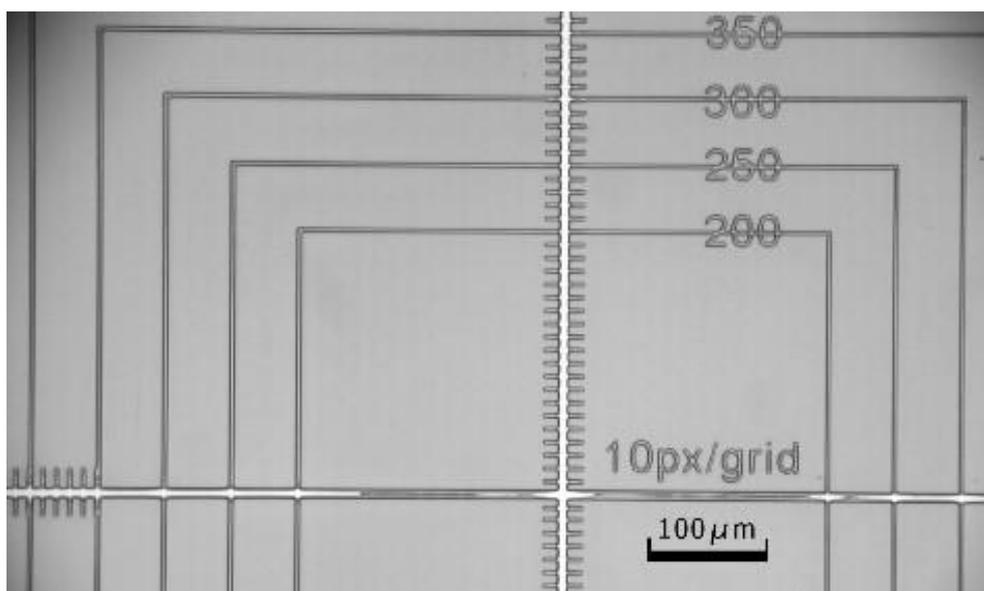
| 波长    | 分辨率   |
|-------|-------|
| 365nm | 500nm |

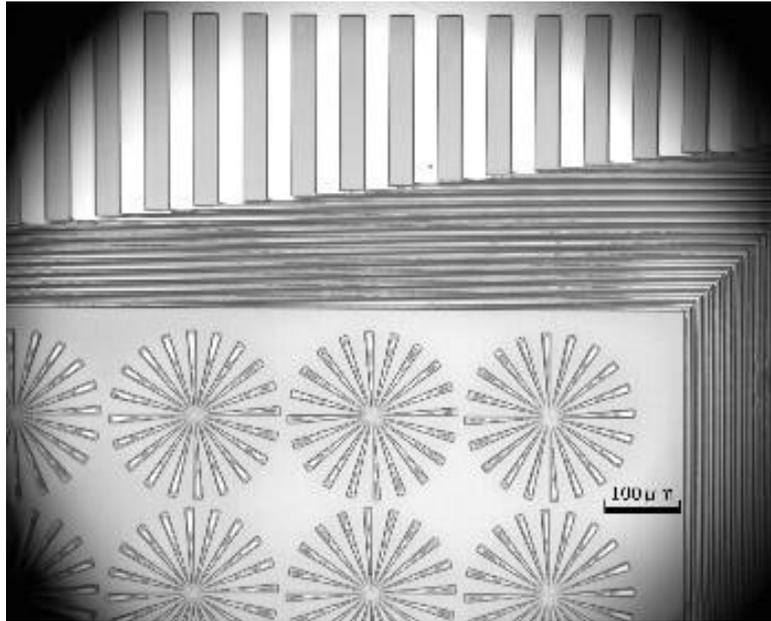
## 详细参数

|                               | MCML-110A             | MCML-120A              |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Wavelength 波长                 | 365nm                 | 365nm                  |
| Max. frame 最大帧                | 100mm x 100mm         | 100mm x 100mm          |
| Resolution 分辨率                | 1.0um                 | 500nm                  |
| Grayscale lithography<br>灰度光刻 | 64 levels             | 128 levels             |
| Max exposure<br>最大曝光量         | 500mJ/cm <sup>2</sup> | 2000mJ/cm <sup>2</sup> |

|                            |                       |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Alignment accuracy<br>对准精度 | <200nm                | <100nm                  |
| field curvature<br>场曲率     | < 1 um                | < 1 um                  |
| Speed<br>速度                | 5mm <sup>2</sup> /sec | 2.5mm <sup>2</sup> /sec |
| Input file<br>输入文件         | BMP, GDSII            | BMP, GDSII              |
| Z level accuracy<br>Z 级精度  | <1 um                 | <1 um                   |
| Environment<br>环境          | 20~25°C               | 20~25°C                 |

### 样品





(SU8-2002, 2um 胶厚, 2 寸硅基底)